

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和7年1月7日(2025.1.7)

【公開番号】特開2023-139392(P2023-139392A)

【公開日】令和5年10月4日(2023.10.4)

【年通号数】公開公報(特許)2023-187

【出願番号】特願2022-44900(P2022-44900)

【国際特許分類】

H 01 L 21/677(2006.01)

10

H 01 L 21/31(2006.01)

H 01 L 21/3065(2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 A

H 01 L 21/31 B

H 01 L 21/302101 G

【手続補正書】

【提出日】令和6年12月23日(2024.12.23)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

前記モジュールを複数有する、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の基板処理システム。

30

40

50